

**先端電子顕微鏡手法に関するシンポジウム
- 新しい結像法と新しい分光法 -**

主催：(独)物質・材料研究機構ナノ計測センター

開催日時：2010年2月5日(金)13時00分～18時00分

交流会(18時30分～20時00分)

開催場所：(独)物質・材料研究機構 研究本館第1会議室(つくば市千現1-2-1)

参加費：無料(交流会は3000円)

詳細WEB：<http://www.nims.go.jp/ancc/event/event.html>

参加申込み方法：上記WEBページの参加申し込みフォームもしくは下記事務局までご連絡ください。一般ポスター発表申し込み締め切りは1月24日です。

連絡先：(独)物質・材料研究機構ナノ計測センター事務局

TEL 029-859-2000 ext6546 Fax 029-859-2801

電子メール：[ancc\(アットマーク\)nims.go.jp](mailto:ancc@nims.go.jp)

開催趣旨：近年、収差補正技術をはじめとする様々な革新的技術の開発が著しい透過型電子顕微鏡の研究分野において、新しい結像法と新しい分光法の研究に取り組んでいる国内の研究者による講演と議論・交流の機会を持つことを目的に、本シンポジウムを開催することになりました。内容：下記招待講演および一般ポスター発表

招待講演

「収差補正STEMを用いた環状明視野法による軽元素サイトの直接観察」
奥西栄治(日本電子)

「収差補正TEM/STEMによるナノカーボン物質の構造評価」
佐藤雄太、末永和知(産業技術総合研究所)

「収差補正STEMによる界面研究の新展開」
柴田直哉、Scott D.Findlay、溝口照康、山本剛久、幾原雄一(東京大学)

「シリコン結晶中のヒ素ドーパント原子検出」
大島義文(東工大)

「電子線トモグラフィ法による結晶性材料の解析」
金子賢治(九大)

「共焦点STEMの開発」
竹口雅樹(物質・材料研究機構)

「TEM内外場制御技術を駆使したマンガン酸化物のナノ構造解析」
村上恭和(東北大)

「TEM用マイクロカロリメータ型EDS 特徴と応用例」
原徹(物質・材料研究機構)

「走査透過電子顕微鏡による極微小領域の結晶構造解析」
木本浩司(物質・材料研究機構)